

平成31年 3月 6日

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部

安全保障貿易管理課 猪狩課長

安全保障貿易審査課 三橋課長

（写）安全保障貿易管理課 熊野課長補佐、飯泉係長

（写）安全保障貿易管理課国際室 荒木課長補佐、渡邊係長

（写）安全保障貿易審査課 井上総括課長補佐、渡井係長

一般財団法人 安全保障貿易情報センター

材料加工専門委員会

測定装置分科会

主査 齊藤 博

6の項にて規制される貨物の規制要件明確化に関する要望

表題の件につきまして、下記の通り要望いたしますので、何卒ご配慮いただけますよう、よろしく願いいたします。

記

1. 要望の背景・趣旨

2019年1月9日施行の政省令等におきまして、規制される貨物の範囲の理解が難しい点がございます。これを明確にするためにQ&A等のご配慮を要望いたします。

2. 明確化いただきたい点

(1) 運用通達解釈 「貨物等省令第5条第八号中の非接触型の測定装置」

本解釈は、WA 2.B.6.b.1. Technical Note を反映したものと理解いたします。

Technical Note 中の”in motion”は、第5条第八号解釈の「動く単一の方向に沿って・・・」と反映されていると考えますが、意味がわかりにくくなっております。

「in motion」とは動いているものを捉えることを指しており、静的にしか測定できないものではなく「連続的に」測定値が得られるものを対象としていることを、確認させていただきたく要望いたします。

貨物等省令第5条第八号中の非接触型の測定装置

測定子又は被測定物が動く単一の方向に沿って、測定子と被測定物との間の距離を測定するように設計されたものを言う。

WA (Wassenaar Arrangement)

2. B. 6. b. Linear displacement measuring instruments or systems, linear position feedback units, and "electronic assemblies", as follows:

Note Interferometer and optical-encoder measuring systems containing a "laser" are only specified in 2.B.6.b.3.

1. 'Non-contact type measuring systems' with a 'resolution' equal to or less (better) than 0.2 μm within 0 to 0.2 mm of the 'measuring range';

Technical Notes

1. *For the purposes of 2.B.6.b.1., 'non-contact type measuring systems' are designed to measure the distance between the probe and measured object along a single vector, where the probe or measured object is in motion.*

2. *For the purposes of 2.B.6.b.1., 'measuring range' means the distance between the minimum and maximum working distance.*

(以下省略)

(2) 運用通達解釈 「貨物等省令第5条第八号中の非接触型の測定装置」「直線上の変位を測定する装置」

6項解釈にあるこの両者は、書きぶりが異なるものの同じものを指すと思われませんが、条文からそのように理解するのは難しくなっております。同じものを指すことを確認させていただきたく要望いたします。

貨物等省令第5条第八号中の非接触型の測定装置

測定子又は被測定物が動く単一の方向に沿って、測定子と被測定物との間の距離を測定するように設計されたものを言う。

直線上の変位を測定する装置

2の「直線上の変位を測定するもの」の解釈に同じ。

直線上の変位を測定するもの（2項）

測定子又は被測定物を移動させることにより、測定子と被測定物との間の距離の変化を測定することができるものをいう。

(3) 直線上の変位を測定する非接触型の測定装置

「直線上の変位を測定する」「非接触型の測定装置」は2項（第1条第十七号ロ（一））と6項（第5条第八号ロ（一））で規制されていると考えますが、両者で規制しているものは同じであることを確認させていただきたく要望いたします。

貨物等省令第1条第十七号

測定装置（工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。）であつて、次のいずれかに該当するもの（第十四号に該当するものを除く。）

イ（省略）

ロ 直線上の変位を測定するものであつて、次のいずれかに該当するもの

（一）非接触型の測定装置であつて、0.2ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が0.2マイクロメートル以下のもの

（以下省略）

貨物等省令第5条第八号

測定装置（工作機械であつても、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。）、位置のフィードバック装置又は測定装置の組立品であつて、次のいずれかに該当するもの（第二号又は第三号に該当するものを除く。）

イ（省略）

ロ 直線上の変位を測定する装置、直線上の位置のフィードバック装置又は測定装置の組立品であつて、次のいずれかに該当するもの（（一）及び（二）にあつては、レーザー干渉計及びレーザーを用いた光学エンコーダを除く。）

（一）非接触型の測定装置であつて、0.2ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が0.2マイクロメートル以下のもの

（以下省略）

(4) 省令第5条第八号ロ(三) 「次の全てに該当するもの」

WAでは規制範囲を変えないというこれまでのご説明とWAのEG会合における経緯より、本項番で規制されるのはこれまで通りレーザーを用いたリニアエンコーダとレーザー干渉計のみであり、レーザーを用いたリニアエンコーダを搭載した形状測定器は本項番の対象ではないことを確認させていただきたく要望いたします。

WAはこれまでに、2.B.6.a.(CNCCMM)、2.B.6.b.(直線上の変位)、2.B.6.c.(角度の変位)、2.B.6.d.(形状測定器)の4カテゴリに整理されたと理解しております。第5条第八号にあてはめ、イ=2.B.6.a.、ロ=2.B.6.b.、ハ=2.B.6.c.、ニ=2.B.6.d.と考えますと、形状測定器はロの対象外のはずです。

WAと貨物等省令の対応関係については別表1と考えますが正しいでしょうか。

貨物等省令第5条第八号

測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。)、位置のフィードバック装置又は測定装置の組立品であって、次のいずれかに該当するもの(第二号又は第三号に該当するものを除く。)

イ 電子計算機又は数値制御装置によって制御される座標測定機であって、(以下略)

ロ 直線上の変位を測定する装置、直線上の位置のフィードバック装置又は測定装置の組立品であって、次のいずれかに該当するもの((一)及び(二)にあつては、レーザー干渉計及びレーザーを用いた光学エンコーダを除く。)

(一) 非接触型の測定装置であつて、0.2ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が0.2マイクロメートル以下のもの

(二) (省略)

(三) 次の全てに該当するもの

1 レーザー光を用いて測定することができるもの

2 測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が0.2ナノメートル以下のもの

3 (省略)

ハ 工作機械用に特に設計した回転位置フィードバック装置又は角度の変位を測定する装置であつて、(以下略)

ニ 光の散乱を角度の関数として処理することにより表面粗さを測定するものであつて、0.5ナノメートル以下の感度を有するもの

以上

別表 1

WA2017		2019年1月9日施行の政省令等	
2.B.6	Dimensional inspection or measuring systems, equipment, position feedback units and "electronic assemblies"	第5条 第八号	測定装置（工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。）、位置のフィードバック装置又は測定装置の組立品であって、次のいずれかに該当するもの（第二号又は第三号に該当するものを除く。）
2.B.6.a	Computer controlled or "numerical controlled" Coordinate Measuring Machines (CMM)	イ	電子計算機又は数値制御装置によって制御される <u>座標測定機</u> であって（以下略）
2.B.6.b	Linear displacement measuring instruments or systems, linear position feedback units, and "electronic assemblies" <i>Note Interferometer and optical-encoder measuring systems containing a "laser" are only specified in 2.B.6.b.3.</i>	ロ	<u>直線上の変位を測定する装置、直線上の位置のフィードバック装置又は測定装置</u> の組立品であって、次のいずれかに該当するもの（（一）及び（二）にあつては、レーザー干渉計及びレーザーを用いた光学エンコーダを除く。） 【解釈】直線上の変位を測定する装置 2の「直線上の変位を測定するもの」の解釈に同じ。 【2項解釈】直線上の変位を測定するもの 測定子又は被測定物を移動させることにより、測定子と被測定物との間の距離の変化を測定することができるものをいう。
2.B.6.b.1	'Non-contact type measuring systems' <i>Technical Note</i> <i>For the purposes of 2.B.6.b.1., 'non-contact type measuring systems' are designed to measure the distance between the probe and measured object along a single vector, where the probe or measured object is in motion.</i>	ロ（一）	非接触型の測定装置（以下略） 【解釈】貨物等省令第5条第八号中の非接触型の測定装置 測定子又は被測定物が動く単一の方向に沿って、測定子と被測定物との間の距離を測定するように設計されたものをいう。
2.B.6.b.2	Linear position feedback units specially designed for machine tools	ロ（二）	工作機械用に特に設計した直線上の位置のフィードバック装置（以下略）
2.B.6.b.3	Measuring systems a. Containing a "laser"; （以下略）	ロ（三）	次の全てに該当するもの。 1 レーザー光を用いて測定することができるもの（以下略） 【解釈】次の全てに該当するもの レーザー干渉計及びレーザーを用いた光学エンコーダは本規定（貨物等省令第5条第八号ロ（三）に基づいて判定するものとする。

2.B.6.b.4	"Electronic assemblies" specially designed to provide feedback capability in systems specified by 2.B.6.b.3	ロ (四)	(三) に該当する測定装置の組立品であって、当該装置にフィードバック機能を付加するように設計したもの
2.B.6.c	Rotary position feedback units specially designed for machine tools or angular displacement measuring instruments <i>Note 2.B.6.c. does not apply to optical instruments, such as autocollimators, using collimated light (e.g., laser light) to detect angular displacement of a mirror.</i>	ハ	工作機械用に特に設計した <u>回転位置フィードバック装置又は角度の変位を測定する装置</u> (平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械を除く。)
2.B.6.d	Equipment for measuring surface roughness (including surface defects), by measuring optical scatter	ニ	光の散乱を角度の関数として処理することにより <u>表面粗さを測定</u> するもの 【解釈】 表面粗さを測定するもの 表面欠陥を測定するものを含む。